

DII Program

'Solution Design Phase' SEMINAR

表題: アカデミアにおける人財育成と産学連携に企業が期待する事

日時: 2022年4月22日(金) 16:30-18:00

場所: 名古屋大学 IB電子情報館 IB014講義室

講師: 足立 正之氏 (株式会社堀場製作所 代表取締役社長)

言語: 日本語

概要:

私自身の国内外におけるアカデミアやビジネスの経験から、産学連携の価値と意義を議論します。また、HORIBAグループが世界各地で進めている幾つかの事例を紹介し、それぞれの仕組みや人財育成のスタイルをレビューします。



略歴:

1962年11月1日生 京都市出身

学歴・職歴

1985年 立命館大学 理工学部 数学物理学科 物理課程 卒業
株式会社堀場製作所入社

1988年～1990年 カリフォルニア大学アーバイン校燃焼研究所 研究員として米国駐在

1999年 同志社大学工学部 博士(工学)取得

2005年

～2007年 早稲田大学大学院非常勤講師

2007年

～2010年 ホリバ・インスツルメンツ社(旧ホリバ・インターナショナル社(米国))社長

2014年

～2015年 ホリバ・フランス社(旧ホリバ・ジヨバンイボン社(仏国))社長

2016年～ ホリバ・フランス社Chairman

2018年～ 株式会社堀場製作所 代表取締役社長 就任、現在に至る

業界団体活動

2014年～ 米国自動車技術会 (SAE International) Fellow

2018年～ (公社)日本環境技術協会 会長

2019年5月～ (一社)日本分析機器工業会 副会長

※事前申し込み (ichiro.nishimoto@dii.engg.nagoya-u.ac.jp) 4/21正午まで